



원자현미경 3차원 스캔형상 교정기술

특허등록번호

10-1371136

특허명

원자현미경 3차원 스캔형상 교정기술

대표발명자

창의융합연구센터 이윤희



나노 소재 표면의 3차원적 구조인 나노압흔 크기에 대한 정량적인 측정 기술



꿈의 신소재라 불리는 그래핀과 나노패턴 등 눈으로 볼 수 없을 만큼 미세한 크기의 나노 물질은 어떻게 관찰할까요? 바로 원자현미경을 통해서 가능한데요, 최근에는 원자현미경을 통해 나노 소재 표면의 3차원적 구조에 대한 간략하고 정량적인 측정 요구가 점점 증가하고 있습니다.

KRISS의 '원자현미경 3차원 스캔형상 교정기술'은 나노압흔 크기에 대한 정량적인 측정을 통해 역학물성 평가가 가능할 뿐 아니라 정량적 정보를 통해 다른 측정 기법의 측정치와 비교가 가능합니다. 또 스캔범위의 증감에 따라 불연속적인 물성 변화가 발생하던 오류까지 해결할 수 있습니다.

나노기술 분야에 종사한다면 KRISS의 신기술을 이전 받아 새로운 원자의 세계를 밝혀보는 것은 어떨까요?